

電子顕微鏡ステーション・ 微細構造解析プラットフォーム 合同セミナー

入場無料

技術講習会ご参加希望の方は、
下記記載の電子顕微鏡ステーション
HPよりお申込み下さい。
(1/21正午〆切)

日時・場所

2019年
1月28日 (Mon.) 10:00~16:30

(受付9:30~)

国立研究開発法人 物質・材料研究機構
千現地区 第2会議室

Time table

10:00-10:10

「挨拶」物質・材料研究機構 竹口 雅樹

10:10-10:40

「次世代透過電子顕微鏡 JEM-F200 ~多目的・高性能のための
様々な次世代技術~」日本電子株式会社 阿井 晴佳/安原 聡

10:40-11:10

「EDSトモグラフィの原理と応用例」日本電子株式会社 青山 佳敬

11:10-11:40

「高感度 EDS による元素分析の基礎と実際」

日本電子株式会社 森田 正樹

11:40-12:10

「STEM-DPC(微分位相コントラスト)からの位相再生」

HREM社 石塚 顕在/石塚 和夫

12:10-13:30

昼休み

13:30-16:30

技術講習会 (定員10名※)

※電子顕微鏡ステーションオープンラボプログラム参加者を優先します。
また、応募者多数の場合は抽選とします。



オープンラボプログラムの装置

お問い合わせ: NIMS電子顕微鏡ステーション事務局 TEL 029-859-2150
HP URL: <https://www.nims.go.jp/tem/> ✉ tem@nims.go.jp



技術講習会
申込QRコード